Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

Факультет	Систем управле	ния и робототехни	ки Группа	R3438
I with a subject to	Cholon Jupabate	inni ii poodioi e mini	ar pyllia	113 130

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Устройство для изм	ерения малых угловых перемещ	ений
Автор работы	Кирбаба Д.Д.	(подпись)
Руководитель	Быстров С.В.	(подпись
Работа выполнена с оценкой	г. Санкт-Петербург,	20г.
Дата защиты " " 20	0 г.	

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

Студенту Кирбабе Денису

ТЕМА: Устройство для измерения малых угловых перемещений

Техническое задание: разработать устройство для измерения малых угловых перемещений подвижного относительно вертикальной оси зеркала, расположенного на оптической скамье. Исходные данные для проектирования:

диапазон измеряемых величин +/- 1 град

допустимая погрешность измерения 2% напряжение питания 220 В 50 Гц

выходной сигнал устройства передать по линии связи RS-485

Номер	Название этапа	Содержание	Срок	Дополнительное
этапа			исполнения	задание
1	Патентный поиск	1. Поиск аналогов по источникам патентной информации (3 аналога разного принципа действия). 2. Сравнительный анализ выбранных аналогов. 3. Выбор принципа действия разрабатываемого устройства.	до 15.10.22	Поиск двух зарубежных аналогов с включением их в сравнительный анализ
2	Техническое предложение	1. Библиографический поиск информации о датчиках, выбранного принципа действия (расчетные формулы, схемы включения и т.д.) 2. Разработка функциональной схемы устройства.	до 15.11.22	Чертеж функциональной схемы
3	Разработка собственного технического решения	1. Разработка принципиальной электрической схемы (или схемы соединений) вторичного преобразователя (наличие микроконтроллера в схеме — обязательно) 2. Выбор источника(ов) питания. 3. Чертеж ЭЗ или Э4	до 30.12.22	Разработка алгоритма функционирования микроконтроллера

Содержание

ВВЕД	ЕНИЕ		•••••		•••••	•••••	5
1 Cpa	авнительный	анал	из су	ществующих аналогов		•••••	6
1.1 П	Iатент 104693 I	Россиі	йская (Федерация (Приложение А)	•••••	•••••	6
1.2 П	І атент 2353899	Pocci	ийская	и Федерация (Приложение Б)			7
1.3 П	І атент 2091708	Pocci	ийская	и Федерация (Приложение B)			8
2 Pas	вработка техн	ничес	ких п	предложений	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	11
2.1 C	Общий вид уста	новки	ıı		•••••	•••••	11
2.2 П	Іорядок работь	і устаі	новки.				12
2.3 A	мализ траекто	рий ді	вижен	ия лучей			13
2.4 Б	локи лазера и	извлеч	нения (сигналов интерферометра			15
2.5 Б	лок обработки	и пер	едачи	сигнала			18
2.6 B	Выбор АЦП и м	икрон	сонтрс	оллера			19
2.7 ₫	ункциональна	я схем	иа устр	ройства			20
3 Pa ₃	вработка собо	ствен	ных т	гехнических решений	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	21
	_			_			
3.2 B	выбор источни	ков пи	тания	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			23
3.3 P	азработка алго	ритма	ι функ	ционирования микроконтроллера			24
Заклю	чение						25
Прилох	кение А						28
Прилох	кение Б						29
Прилох	кение В						30
_							
-							
		<u> </u>	l I				
Mary Turns	No James	<i>[</i>] = 3 =	// av rea av	ФСУиР.215.R343	3 8. 00.	1 ПЗ	
	№ оокум. Кирбаба Д.Д.	110011.	дата		Лит.	Лист	Листов
Пров.	Быстров С.В.			Устройство для измерения		3	25
				малых угловых перемещении Пояснительная записка	Φι	акультет (СУиР
	1 Срада 1.1 Г. 1.2 Г. 1.3 Г. 1.3 Г. 2 Раз 2.1 С. 2.2 Г. 2.3 А. 2.4 Б. 2.5 Б. 2.6 В. 2.7 Ф. 3 Раз 3.1 Р. 3.2 В. 3.3 Р. 3аклю Списо Прилож При Прилож Прилож При При Прилож При При При При При	1 Сравнительный 1.1 Патент 104693 В 1.2 Патент 2353899 1.3 Патент 2091708 2 Разработка техн 2.1 Общий вид уста 2.2 Порядок работь 2.3 Анализ траектор 2.4 Блоки лазера и в 2.5 Блок обработки 2.6 Выбор АЦП и м 2.7 Функциональна 3 Разработка собо 3.1 Разработка прив 3.2 Выбор источния 3.3 Разработка алго Заключение Список использова Приложение Б Приложение Б Приложение Б Приложение Д Приложение Д Приложение Д Изм. Лист № докум. Разраб. Кирбаба Д.Д. Пров. Быстров С.В.	1. Сравнительный анал. 1.1 Патент 104693 Россий 1.2 Патент 2353899 Россий 1.3 Патент 2091708 Россий 2. Разработка техничес 2.1 Общий вид установки 2.2 Порядок работы устан 2.3 Анализ траекторий двя 2.4 Блоки лазера и извлеч 2.5 Блок обработки и пер 2.6 Выбор АЦП и микров 2.7 Функциональная схем 3 Разработка собствен 3.1 Разработка принципи 3.2 Выбор источников пи 3.3 Разработка алгоритма Заключение Список использованных Приложение Б	1 Сравнительный анализ су 1.1 Патент 104693 Российская 1.2 Патент 2353899 Российская 1.3 Патент 2091708 Российская 2 Разработка технических г 2.1 Общий вид установки 2.2 Порядок работы установки 2.3 Анализ траекторий движен 2.4 Блоки лазера и извлечения 2.5 Блок обработки и передачи 2.6 Выбор АЦП и микроконтро 2.7 Функциональная схема уст 3 Разработка собственных 3.1 Разработка принципиально 3.2 Выбор источников питания 3.3 Разработка алгоритма функ Заключение Список использованных исто Приложение В Приложение В Приложение В Приложение Д Приложение Д Приложение Д Пров. Быстров С.В. Н. контр.	1.1 Патент 104693 Российская Федерация (Приложение А)	1.1 Патент 104693 Российская Федерация (Приложение А)	1.1 Патент 104693 Российская Федерация (Приложение А) 1.2 Патент 2353899 Российская Федерация (Приложение Б) 1.3 Патент 2091708 Российская Федерация (Приложение В) 2 Разработка технических предложений 2.1 Общий вид установки 2.2 Порядок работы установки 2.3 Анализ траскторий движения лучей 2.4 Блоки лазера и извлечения сигнала интерферометра 2.5 Блок обработки и передачи сигнала 2.6 Выбор АЩП и микроконтроллера 2.7 Функциональная схема устройства 3 Разработка собственных технических решений 3.1 Разработка алгоритма функционирования микроконтроллера 3.2 Выбор источников питания 3.3 Разработка алгоритма функционирования микроконтроллера 3аключение Список использованных источников Приложение В Приложение В Приложение Д ФСУИР.215.R3438.001 ПЗ Разраб. Кирбабо ДД. Поров. Быстров С.В. Истройство для измерения длит. Лист Малых угловых перемещений налько угловых перемещений для измерение Факуновем образованием образованием образованием образованием образованием образования обра

Приложение Е	33
Приложение Ж	34
Приложение 3	35
Приложение И	36
Приложение К	37
Приложение Л	38
Приложение М	39

Подп. и дата Взам. Инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ФСУиР.215.R3438.001 ПЗ

Лист

ВВЕДЕНИЕ

В данной курсовой работе поставлена цель разработки устройства для измерения малых угловых перемещений подвижного относительно оси зеркала, расположенного на оптической скамье. Исходные данные для проектирования:

- 1. Диапазон измеряемых величин ± 1 град
- 2. Допустимая погрешность измерения 2%
- 3. Напряжение питания 220 В 50 Гц
- 4. Выходной сигнал устройства по линии связи RS 485

По ходу работы требуется провести анализ существующих технических решений, по результатам патентного и библиографического поиска выбрать принцип действия своего устройства, разработать функциональную схему устройства, разработать принципиальную электрическую схему вторичного преобразователя и выбрать источник питания.

ъ́л. Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. Инв. Nº	
Подп. и дата	
№ подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

По результатам патентного библиографического поиска представлен анализ известных технических решений (см. Приложения А-В)

1.1 Патент 104693 Российская Федерация (<u>Приложение А</u>)

Устройство для измерения угловых перемещений

https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips servlet?DB=RUPM&DocNumber=104693&TypeFile=html

Устройство включает подвижный модуль в виде зубчатого колеса 1 и магнитный преобразователь 4. Колесо 1 сопряжено с объектом пользователя. Преобразователь 4 расположен в корпусе 5 и имеет возможность дистанционного (бесконтактного) взаимодействия с венцом 2 колеса 1. Изображение устройства приведено на Рисунке А.1.

Внутри корпуса 5 размещены плата обработки 7, магниточувствительные элементы 8 и постоянные магниты 9. Плата 7 соединена с элементами 8. Элементы 8 сопряжены с венцом 2. Элементы 8 расположены параллельно венцу 2 и выполнены по отношению к венцу 2 со смещением на величину равную $p \cdot (n+1/4)$, где p - шаг зубьев венца, n - число зубьев (целое). Магниты 9 установлены между платой 7 и элементами 8 и соединены с ними. Магниточувствительный элемент 8 представляет собой специальную микросхему прямоугольной формы (например, 2SA-10 фирмы Sentron AG), в которой используется эффект Холла.

Данное устройство для измерения угловых перемещений осуществляет свою работу следующим образом.

При вращении зубчатого колеса 1 зубья 3 его венца 2 периодически срабатывания входят зону выходят отпускания ИЗ зоны магниточувствительных 8, элементов при ЭТОМ на выходах магниточувствительных элементов 8 формируются импульсы напряжения (тока), которые смещены относительно друг друга на четверть периода.

В этом случае количество импульсов характеризует величину угла поворота зубчатого колеса 1 и скорость его вращения. Поскольку

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв. Nº дубл.

Š

Взам. Инв.

Подп. и дата

Инв. N<u>º</u> подл.

ФСУиР.215.R3438.001 ПЗ

Выполнение магниточувствительных элементов 8 со смещением по отношению к венцу 2 зубчатого колеса 1 (при параллельном их расположении) обеспечивает возможность считывания информации об угле поворота зубчатого колеса 1.

1.2 Патент 2353899 Российская Федерация (Приложение Б)

Устройство для автоматизированного измерения малых угловых перемещений

https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2353899&TypeFile=html

Устройство для автоматизированного измерения малых угловых перемещений содержит лазер, предназначенный для скрепления с объектом, зеркальный блок, выполненный В виде полупрозрачного зеркала, расположенного по ходу излучения от лазера и расположенного по ходу отраженного от полупрозрачного зеркала излучения глухого зеркала, на расстоянии, зависящем от требуемой точности измерений, оптически связанный с зеркальным блоком фоточувствительный прибор, выполненный в виде линейного фоточувствительного прибора с зарядовой связью (ЛФПЗС), блок индикации, синхрогенератор, два цифровых компаратора, генератор, счетчик, два триггера, элемент ИЛИ, два элемента И, элемент ИЛИ-НЕ, два аналого-цифровых преобразователя, два цифровых фильтра, два элемента задержки.

В плоскости анализа возникает интерференционная картина, проецируемая на фоточувствительную область ЛФПЗС, вызывая появление видеосигналов на выходах ЛФПЗС, однозначно соответствующих

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв. Nº дубл

Š

Взам. Инв.

Подп. и дата

Инв. N<u>º</u> подл.

проецируемой интерференционной картине. Видеосигналы преобразуются в последовательный цифровой код. Вычисление измеряемой величины производится аппаратно, результат измерения выводится на индикацию.

Схема устройства изображена на Рисунке Б.1.

1.3 Патент 2091708 Российская Федерация (Приложение В)

Устройства для измерения линейных и угловых перемещений https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2091708&TypeFile=html

Устройство для измерения линейных и угловых перемещений содержит измерительный растр 1, два канала считывания, состоящие из осветителей 2, растров 3, сопряженных \mathbf{c} измерительным фотоприемников 4. Сигнал с выхода фотоприемников 4 поступает через формирователи 5 на входы дешифратора 6, выходы которого соединены с входами Р - триггеров 7, 8, 9. Элементы ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 10, инвертор 11, ждущий мультивибратор 12, схема И 13 обеспечивают формирование счетного импульса координат, поступающего на вход реверсивного счетчика координат 14. При этом исключаются ошибки определения координаты при многократном реверсировании направления перемещения и вибрациях растра. 18, Генератор импульсов счетчик 16, регистр счетных длительностей интервалов времени 15 обеспечивают измерение длительностей интервалов времени между поступлением счетных импульсов координат, что необходимо для работы блока определения координаты, скорости и ускорения 17 для заданного момента времени.

Z	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	. Дат
Инв. № подл.					
лодл.					
Подп.					

Подп. и дата

Инв. Nº дубл.

Взам. Инв. №

Сравнительный анализ выбранных аналогов.

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ устройств

	Устройство 1.1	Устройство 1.2	Устройство 1.3
Способ выдачи информации	Инкрементальный	Абсолютный	Абсолютный
Принцип действия	Магнитный	Оптический	Оптический
Скрепление с	Посредством	Посредством	Посредством
объектом	сопряжения колеса с	лазера	сопряжения
	объектом		измерительного
			растра с объектом
Обработка	Обработка импульсов	Анализ	Анализ сигналов
сигнала	от двух смещенных	интерференционно	от двух каналов
	магниточувтсвительны	й картины на	считывания
	х элементов	фоточувствительно	(осветлитель,
		м приборе,	индикаторный
		который оптически	растр,
		связан с	фотоприемник)
		зеркальным	
		блоком, через	
		который проходит	
		лазер	
Точность	Зависит от размера	Высокая	Зависит от
измерений	зубьев		количества рисок
			на оптическом
			диске
Реализация	Невозможна, так как:	Возможна	То же самое, что в
поставленной	отсутствует		у устройства №1
задачи	возможность		
	сопряжения устройства		

Инв. Nº подл.

Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. Nº дубл.

Взам. Инв. №

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ФСУиР.215.R3438.001 ПЗ

Лист

Выбор принципа действия разрабатываемого устройства.

Принцип действия разрабатываемого устройства будет похож на устройство № 2, то есть для измерения малых угловых смещений зеркала, перемещаемого относительно оси на оптической скамье, будем использовать так называемый лазерный интерферометр.

Принцип работы лазерного интерферометра заключается в разделении лазерного луча на два отдельных пути. Одна траектория направлена на неподвижное эталонное зеркало, а другая - на зеркало, угловое смещение которого мы хотим измерить.

Лазерный луч отражается от обоих зеркал и рекомбинирует, образуя интерференционную картину. Затем интерференционная картина регистрируется фотоприемником.

Когда зеркало находится в состоянии покоя, интерференционная картина будет стабильной. Однако при угловом смещении зеркала

интерференционная картина будет смещаться. Анализируя это смещение интерференционной картины, можно определить величину углового смещения.

Z	ИНВ. Nº ПООЛ	поол.	пооп. и оата
Изм.			
ŀ			

Подп. и дата

Инв. Nº дубл

Взам. Инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2 Разработка технических предложений

2.1 Общий вид установки

В нашей задаче по необходимо измерять малые угловые перемещения подвижного относительно вертикальной оси зеркала, расположенного на горизонтальной оси. То есть угол рыскания поверхности зеркала θ .

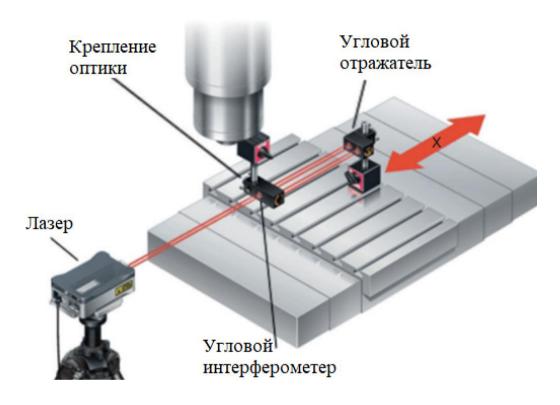


Рисунок 2.1 – Типовая установка для измерения угла рыскания

Устройство представленное выше на Рисунке 2.1. является типичной установкой для измерения угла рыскания при линейном движении оси X станка с подвижным столом станка. В состав установки входят три ключевых компонента:

- 1. Лазер (установлен на штативе)
- 2. Угловой интерферометр (прикреплен к шпинделю)
- 3. Угловой отражатель (закреплен на подвижном столе (в случае нашей задачи необходимо будет закрепить угловой отражатель на поверхности зеркала))

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
			•	•

Подп. и дата

Инв. Nº дубл

Š

Взам. Инв.

Подп. и дата

2.2 Порядок работы установки

Для измерения угла рыскания зеркала, установленного на оптической скамье, с помощью лазерного интерферометра необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Установка лазерного интерферометра на устойчивую поверхность и его выравнивание. Лазерный луч должен быть направлен на поверхность зеркала
- 2. Выполнить процедуру калибровки интерферометра, чтобы установить опорную точку или нулевое положение интерферометра
- 3. Установка зеркала на оптической скамье. Зеркало должно быть выровнено и расположено перпендикулярно лазерному лучу
- 4. Отрегулируйте настройки интерферометра для получения требуемого разрешения и чувствительности измерений
- 5. Интерференционная картина, создаваемая лазерным лучом, отражающимся от поверхности зеркала будет меняться при повороте зеркала на различные углы рыскания. Необходимо зафиксировать интерференционную картину для её дальнейшего анализа
- 6. Анализ интерференционной картины и извлечения соответствующих данных. Для анализа используются изменения в интерференционных полосах или фазовые сдвиги, вызванные поворотом зеркала
- 7. На основании изменений интерференционной картины рассчитать угол рысканья зеркала

Изм. Лист № докум. Подп.

Дата

Подп. и дата

Инв. Nº дубл.

Взам. Инв. №

ФСУиР.215.R3438.001 ПЗ

Лист

Рассмотрим траектории движения лучей в данной установке, показанные на Рисунке 2.2.

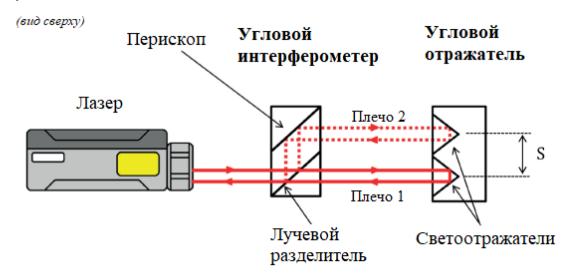


Рисунок 2.2 – Оптические пути установки при нулевом угле рыскания

Угловой интерферометр содержит комбинированный лучевой разделитель/перископ, а угловой отражатель - два светоотражателя с межосевым расстоянием S.

Когда выходной луч лазера попадает в угловой интерферометр, он разделяется на два отдельных луча внутренним разделителем. Один луч (сплошной красный) направляется прямо на нижний светоотражатель и образует "плечо 1" интерферометра. Другой луч (пунктирный красный) отражается вверх от разделителя и затем отражается от зеркала перископа на верхний светоотражатель, образуя "плечо 2" интерферометра. Затем оба луча отражаются от светоотражателей обратно. Попадая в угловой интерферометр, они рекомбинируются и направляются обратно в блок детектирования лазерной установки, где интерферируют, формируя измерительный сигнал.

Итак, принцип измерения угла рыскания основывается на определении относительного изменения длины оптического пути в двух "плечах" интерферометра (ΔL).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв. Nº дубл

Š

Взам. Инв.

Подп. и дата

Инв. N<u>º</u> подл.

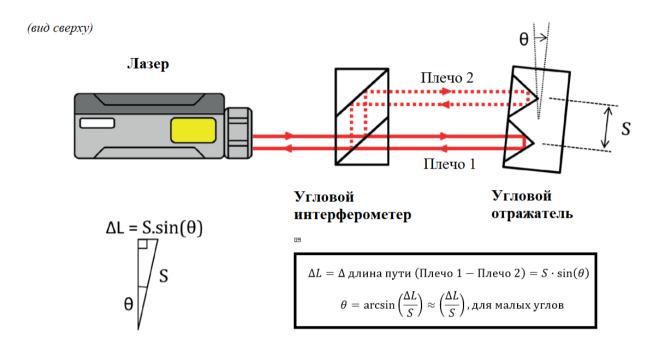


Рисунок 2.3 – Оптические пути установки при ненулевом угле рыскания.

При наклоне зеркала на угол θ луч в плече 1 станет короче на

$$1/2 \cdot S \cdot sin(\theta)$$

по мере продвижения к нижнему светоотражателю.

В то же время луч в плече 2 будет удлиняться на $1/2 \cdot S \cdot sin(\theta)$.

Таким образом, относительное изменение длины пути между плечами 1 и 2 интерферометра составит

$$\Delta L = 1/2 \cdot S \cdot \sin(\theta) + 1/2 \cdot S \cdot \sin(\theta) = S \cdot \sin(\theta)$$

Заметим, что поскольку лучи проходят туда и обратно между угловым интерферометром и отражателем, то общее изменение ПУТИ отражателем, общее изменение длины пути удваивается и составляет

$$2 \cdot S \cdot sin(\theta)$$

Это пути регистрируется интерференционным изменение длины счетчиком/интерполятором в детекторном блоке лазера (подсчитывается

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	И

количество полос контрастной яркости или темноты, возникающее при интерференции) и преобразуется в линейное расстояние ΔL путем умножения на длину волны лазера / 2:

 $\Delta L =$ количество полос · (длина волны лазера)/2.

Далее, программное обеспечение лазерной системы преобразует относительное изменение длины пути ΔL в угол:

$$\theta = arcsin(\Delta L/S)$$
,

где S - расстояние между светоотражателями.

2.4 Блоки лазера и извлечения сигналов интерферометра

В данных блоках устройства должны присутствовать следующие компоненты:

- 1. Модулятор лазерного сигнала
- 2. Драйвер лазерного сигнала
- 3. Источник лазера
- 4. Фотоприемник
- 5. Конденсаторы
- 6. Усилители

Подп. и дата

дубл.

Инв. №

ş

Инв.

Взам.

Подп. и дата

Инв. N<u>º</u> подл.

7. Полосовые фильтры

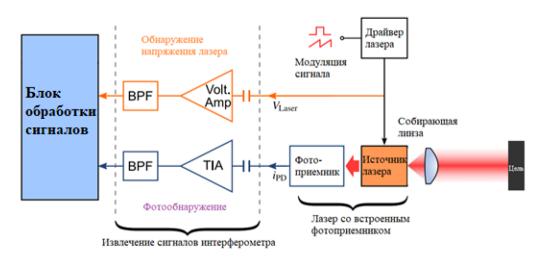


Рисунок 2.4 – Схема блоков лазера и извлечения сигналов интерферометра с внутренним фотоприемником

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Управление током лазера осуществляется с помощью лазерного драйвера, через который может быть применена электрическая модуляция. Интерферометрические сигналы получают с помощью платы сбора данных, на которую подаются сигналы через трансимпедансный усилитель (ТИУ) и полосовой фильтр (ВРF), а также напряжение лазера через усилитель напряжения (Volt. Amp) и полосовой фильтр (ВРF).

После этого отфильтрованный аналоговый сигнал поступает в блок обработки сигналов.

В качестве источника лазера будем использовать лазерный диод.

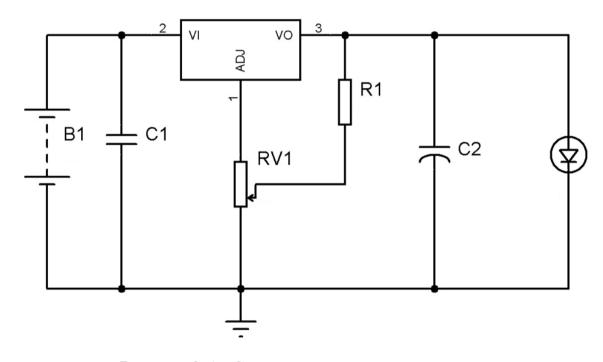


Рисунок 2.5 – Схема включения лазерного диода

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Подп. и дата

Инв. Nº дубл.

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

В качестве фотоприемника будем использовать фотодиод.

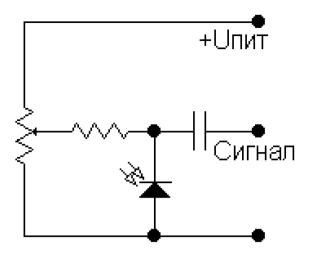


Рисунок 2.6 – Схема включения фотодиода

Трансимпедансный усилитель (ТИА) используем для преобразования тока в напряжение и последующее усиление.

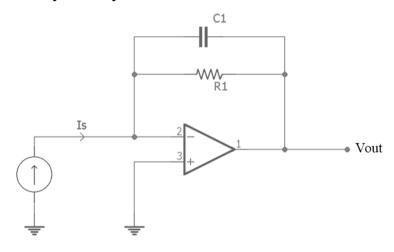


Рисунок 2.7 – Схема включения трансимпедансного усилителя

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

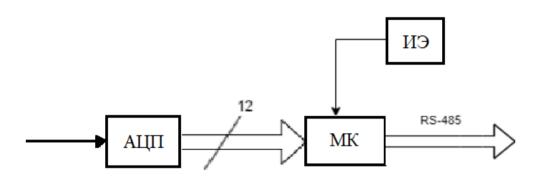
Инв. Nº дубл.

Взам. Инв. №

Подп. и дата

После работы предыдущего блока устройства мы получили отфильтрованный аналоговый сигнал.

Рассмотрим блок обработки и передачи сигналов.



Блок обработки сигналов

Рисунок 2.8 – Схема блока обработки и передачи сигналов:

ИЭ – источник электропитания; МК – микроконтроллер; АЦП – аналогоцифровой преобразователь

Опишем этапы работы данной подсистемы:

- 1. Данные сигналов интерферометра передаются в АЦП. Где преобразуется в цифровой сигнал для последующей обработки.
- 2. По шине данных цифровой код передается в микроконтроллер, где происходят следующие действия:
- а. Обнаружение интерференционных полос, формируемой лазерным интерферометром. Эти полосы выглядят как чередующиеся светлые и темные области, возникающие в результате конструктивной и деструктивной интерференции двух лучей. Каждый переход соответствует обнаружению одной полосы.
- б. Подсчет интерференционных полос, наблюдаемых в интерференционной картине. Могут использоваться различные методы

Инв. № подл. и дата Взам. Инв. № Инв. № дубл

Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ФСУиР.215.R3438.001 ПЗ

точного подсчета полос, такие как алгоритмы обнаружения краев, пороговые алгоритмы или алгоритмы распознавания образов.

- в. По мере изменения интерференционной картины в связи с изменением угла поворота зеркала отслеживаются переходы между полосами. Происходит накопление количества интерференционных полос, обнаруженных за определенный период времени или заданный интервал измерений.
- г. Подсчитывая количество обнаруженных интерференционных полос, счетчик позволяет получить количественную оценку относительного изменения длины пути (ΔL), вызванного изменением угла поворота зеркала. Этот отсчет используется в последующих расчетах для определения линейного расстояния (ΔL) и, в конечном счете, угла наклона зеркала.
- 3. Передача вычисленного угла рыскания зеркала передается по каналу связи RS-485.

2.6 Выбор АЦП и микроконтроллера

В соответствии с техническим заданием был выбран микроконтроллер STM32H747 от STMicroelectronics (см. Приложение Γ).

Выбранная модель МК обладает процессором Cortex-M7, работающим на максимальной частоте 480 МГц. Также микроконтроллер имеет режим низкого энергопотребления для оптимизации энергоэффективности, который позволит преобразователю работать длительное время в автономном режиме, например, при питании от электрической батареи. Типовое напряжение питания составляет 3.3B, которое будем подавать преобразователь напряжения DC/DC по шине питания.

МК может работать с 35 коммуникационных интерфейсов, по двум из них мы будем принимать аналоговые данные, которые будут преобразованы внутренним 16-битным АЦП контроллером DMA, который сразу же будет перенаправлять данные к порту вывода, работающий по протоколу RS-485.

Подп. и	
инв. N <u>º</u> дубл.	
Взам. Инв. Nº	
Подп. и дата	
Инв. N <u>º</u> подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2.7 Функциональная схема устройства

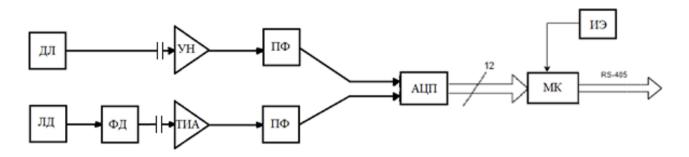


Рисунок 1.9 – Функциональная схема разрабатываемого устройства:

ДЛ – драйвер лазера; ЛД – лазерный диод; ФД – фотодиод; УН – усилитель напряжения; ТИА – трансимпедантный усилитель; ПФ – полосовой фильтр; ИЭ – источник электропитания; АЦП – аналого-цифровой преобразователь; МК – микроконтроллер

Принцип действия прибора поясняет схема, приведенная на Рисунке 2.9. Выделим основные шаги работы:

- 1. Фотодетектор отвечает за преобразование входящего оптического сигнала в электрический, он генерирует ток, пропорциональный интенсивности входящего света.
- 2. Электрический сигнал, генерируемый фотодетектором, слаб. Чтобы усилить его и сделать пригодным для дальнейшей обработки, сигнал проходит через стадию усиления.
- 3. Фильтрация: в некоторых случаях электрический сигнал от фотодетектора может содержать нежелательные шумы или высокочастотные составляющие. Для удаления этих нежелательных элементов сигнал пропускается через полосовой фильтр. Фильтр пропускает только нужный частотный диапазон сигнала помехи, ослабляя ненужные частоты.
- 4. Усиленный и отфильтрованный сигнал подвергается обработке, чтобы сделать его совместимым с последующими этапами работы. В конкретно нашем случае мы произведем преобразование сигнала в цифровой формат для дальнейшего анализа.

			случ йшег
Изм.	Лист	N	<u> доку</u> г

Подп.

Дата

Подп. и дата

Инв. Nº дубл.

Инв. №

Взам.

Подп. и дата

Инв. № подл.

ФСУиР.215.R3438.001 ПЗ

- 5. Счетчик интерференционных полос. Этот компонент отвечает за подсчет количества интерференционных полос, наблюдаемых в интерференционной картине.
 - 6. Преобразование в линейное расстояние:
 - $\Delta L =$ количество полос · (длина волны лазера)/2.
- 7. Обработка и передача данных: измеренное линейное расстояние (ΔL) затем обрабатывается программным обеспечением лазерной системы:

$$\theta = arcsin(\Delta L/S)$$

Можно также выполнить усреднение или коррекцию ошибок для получения точных измерений. Конечный результат (угол рыскания) передается по линии связи RS-485.

3 Разработка собственных технических решений

3.1 Разработка принципиальной схемы

С учетом сделанных выше численных оценок и обоснованно выбранной концепции, синтезирована принципиальная схема устройства измерения малых угловых перемещений, показанная ниже на Рисунке 3, а перечень её элементов на листе ФСУиР.215.R3438 ПЭЗ.

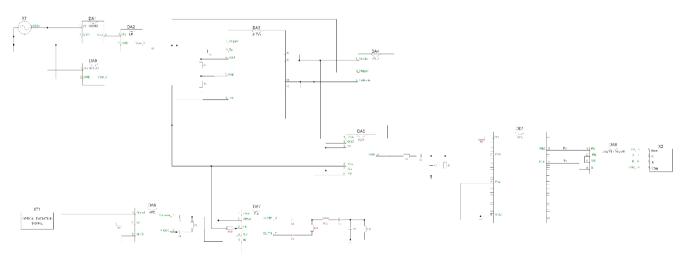


Рисунок 3 – Принципиальная схема устройства

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв. Nº дубл.

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Также разработанная электрическая принципиальная схема представлена на отдельном листе с шифром ФСУиР.215.R3438.001 ПЗ.

Опишем функционирование данной схемы.

С помощью разъема X1 на схему осуществляется подача питания от сети переменного напряжения 220 вольт с частотой 50 герц. Блок питания DA1 (см. Приложение Д) преобразовывает переменное напряжение в постоянное напряжение с понижением до 5 вольт.

Далее, так как большинство компонентов работают при напряжении 3.3 вольт, в схеме присутствует линейный регулятор DA2 (см. Приложение 3), на котором происходит понижение напряжения до необходимых 3.3 В.

DA3 (см. Приложение Е) представляет собой драйвер импульсного лазерного диода, он имеет два входа PL и PP, которые определяются сопротивлениями соответствующих резисторов и с помощью них настраиваются период и сила импульсов соответственно. На выходе данной микросхемы мы получаем напряжение, которую подаём на импульсный лазерный диод DA4 (см. Приложение И).

Лазерный диод DA4 испускает изучение определенной конфигурации, которую мы задали с помощью драйвера DA3.

Также для анализа интерференционной картины нам требуется помимо отраженного сигнала от зеркала, напряжения, которые были синтезируемы драйвером DA3, поэтому мы его снимаем и подаем на усилитель напряжения DA5 (см. Приложение К) и пропускаем через пассивный полосовой фильтр, используемый для фильтрации определенных частот, которые находятся в конкретной полосе или диапазоне частот.

Итак, мы получили первый сигнал, который можно передавать на микроконтроллер.

Теперь проследим за получением сигнала с отраженного луча от зеркала. Отраженный сигнал попадает на фотодиод DA6 (см. Приложение Ж), который питается от второго блока питания DA9 с выходом 48 вольт (см. Приложение

Подп. и дата Взам. Инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ФСУиР.215.R3438.001 ПЗ

1. Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. Инв.

ş

Подп. и дата

Инв. № подл.

М). Далее, ток с фотодиода мы передаем на трансимедансный усилитель DA7 (см. Приложение Л), который управляется током, а не напряжением как в обычных операционных усилителях.

Далее, напряжение с выхода микросхемы DA7 пропускаем через полосовой фильтр и получаем готовый к передаче на МК сигнал.

Два сигнала передаем на вход АЦП нашего микроконтроллера, где эти данные преобразуются в цифровую форму и будут готовы к преобразованиям для анализа интерференционной картины и расчета углового перемещения объекта.

После вычислительных операций на процессоре микроконтроллера, данные отправляются на порты вывода GPIO, с дальнейшей передачей на микросхему DA8 (см. Приложение H) для конечной передачи по интерфейсу RS-485 по разъему X2.

3.2 Выбор источников питания

Для корректной работы выбранных компонентов необходимо подавать на них постоянное напряжение в размере 3.3 вольта, соответственно необходимо произвести две операции:

- 1. Преобразование переменного напряжения в постоянное
- 2. Понижение постоянного напряжения с 5 вольт до 3.3 вольт

Для преобразования переменного напряжения в постоянного используем AC/DC блок питания Mean Well EPS-15-5 (см. Приложение Д).

А последующее понижение выполним с помощью линейного регулятора, отмеченного на схеме блоком DA2.

Мощность выбранного блока питания составляет 9.9 Вт, её будет с запасом достаточно для питания всех компонент.

Также нам необходим второй блок питания с выходом 20-80 вольт, который будет питать импульсный лазерный диод, в соответствии с данным фактом в схеме присутствует блок питания Mean Well EPP-150-48 (см Приложение М).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.3 Разработка алгоритма функционирования микроконтроллера

Для приема аналоговых сигналов используется блок АЦП (ADC) на МК и контроллер DMA (для перемещения данных напрямую в память МК с внешних выводов и обратно, не загружая процессов CPU). Для отправки данных будем использовать порты вывода общего назначения GPIO, данные будут отправляться по протоколу USART на микросхему DA8.

Итак, вначале необходимо инициализировать внешние выводы для входов АЦП и порты вывода GPIO. Также производится настройка тактирования процессора и шин, по которым проходят данные, отметим, что мы будем использовать внутренний источник тактирования МК. Далее необходимо настроить компоненты ADC, DMA, USART на корректную работу, а именно:

- 1. ADC: настраиваем каналы как регулярные, устанавливаем преобразование в непрерывном режиме, а также включаем генерацию прерывания по окончании преобразования.
- 2. DMA: один канал настраиваем на запись данных с ADC в память МК, а другой на перемещение уже итогового результата из памяти МК на порты вывода GPIO. Режим в обоих случаях ставим циклический.
- 3. USART: устанавливаем конфигурацию канала (baud rate, word length, наличие бита четности, наличие терминального символа).

Итак, после настройки всех компонентов МК можно описать принцип вычислений над данными.

Входные данные — напряжение синтезированное драйвером лазерного диода и напряжение снятое с фотодиода. Оба значения будут автоматически добавляться в массивы-буферы, которые были указаны при инициализации callback-функции блоков ADC и DMA.

Описанный ниже алгоритм, помещается в основной цикл программы.

На основе этих двух массивов данных производится операция их наложения и подсчет количества полос яркости (в зависимости от частоты и

дубл. Подп. и дата

Nº | Инв. № дубл

Инв.

Подп. и дата Взам.

Инв. N<u>º</u> подл.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ФСУиР.215.R3438.001 ПЗ

 $\Delta L =$ количество полос \cdot длина волны лазера 2 .

Далее, происходит вычисление финального значения:

$$\theta = arcsin\left(\frac{\Delta L}{S}\right),\,$$

где S - расстояние между светоотражателями.

После выполнения данной операции данные будут отправляться на порты вывода с помощью DMA.

Заключение

В данной работе было разработано устройство для измерения малых угловых перемещений подвижного относительно вертикальной оси зеркала, расположенного на оптической скамье. Работа выполнялась в 3 этапа:

- 1. Патентный поиск
- 2. Техническое предложение
- 3. Разработка собственного технического решения

На первом этапе был проведен разбор задания, анализ существующих реализаций и выбор итогового варианта. По итогам была создана сравнительная таблица 3-х различных устройств для измерения углового перемещения (см. Таблица 1.1). Исходя из условий задачи был выбран тип преобразователя, основывающийся на лазерном интерферометре.

Во время второго этапа был описан принцип действия создаваемой установки с приведением формул и рисунков. Были представлены зависимости между значением измеряемой величины (угловое перемещение зеркала) и параметрами системы, которые будут детектироваться установкой и далее будет производиться расчет требуемой величины на МК.

Также здесь были подобраны необходимые для функционирования установки датчики и электрические блоки. В конце этапа была представлена

Подп. и дата

функциональная схема устройства (см. Рисунок 2.9), на которой отражены основные блоки преобразователя.

На заключительном третьем этапе была разработана электрическая принципиальная схема ЭЗ (см. Рисунок 3). На нем изображены все компоненты необходимые для реализации работы преобразователя. Также для каждого блока, представлен его паспорт в соответствующих приложениях. После выбора всех компонент был произведен поиск подходящих под энергитические запросы устройства блоков питания.

Итого, устройство питается от сети переменного тока 220 В 50 Гц и использует два блока питания для питания элементов схемы и измерительного преобразователя. Выходной сигнал устройства передается по линии связи RS-485.

Также в пункте 3.3 был представлен алгоритм работы микроконтроллера STM32 для приема, обработки, вычисления и последующей отправки значений.

Проделанная работа получилась объемной, в процессе выполнения приходилось изучать много новой, вспоминать уже изученную информацию, и самое главное применять их на практике.

Инв. № подл. и дата Взам. Инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ФСУиР.215.R3438.001 ПЗ

Лист

Список использованных источников

- 1. Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. Перевод с английского Ю.А.Заболотной под редакцией Е.Л.Свинцова. –М., Техносфера. 2005.-588 с.
 - 2. Maloberti Fr. Data converters. Springer New York, NY. 2007, 440.
- 3. Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и средства измерений. –М.: Издательский центр "Академия", 2004.
- 4. Коронкевич В.П., Ханов В.А. Современные лазерные интерферометры. 1985. 180 с.
- 5. Ландсберг Г.С. Оптика. Учеб. пособие: Для вузов. 6-е изд., стереот. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. -848 с.
- 6. Блинников А.А, Бойков В.И., Быстров С.В., Николаев Н.А., Нуйя О.С. Правила оформления пояснительной записки и конструкторской документации. СПб: Университет ИТМО, 2014. 55 с

Подп. и дата				
Инв. № дубл.				
Взам. Инв. Ng				
Подп. и дата				
1000	1			

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Приложение А

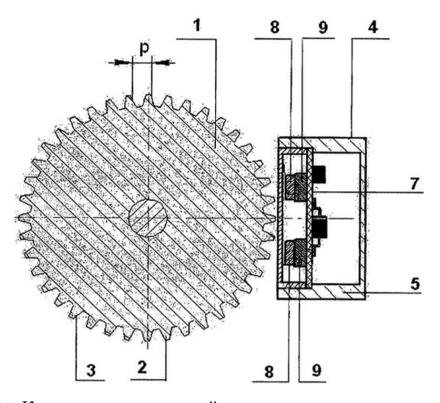


Рисунок А.1 – Конструкция для устройства измерения угловых перемещений: подвижный модуль в виде зубчатого колеса – 1; венец (колеса 1) – 2; зубья (венца 2) - 3; магнитный преобразователь – 4; корпус (преобразователя 4) – 5; защитную крышку (корпуса 5) – 6; плату обработки (в корпусе 5) – 7; магниточувствительные элементы (на плате 7) – 8; постоянные магниты (между платой 7 и элементами 8) – 9

Подп. и дата	
инв. N <u>º</u> дубл.	
Взам. Инв. Ne	
Подп. и дата	
\9 подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Приложение Б

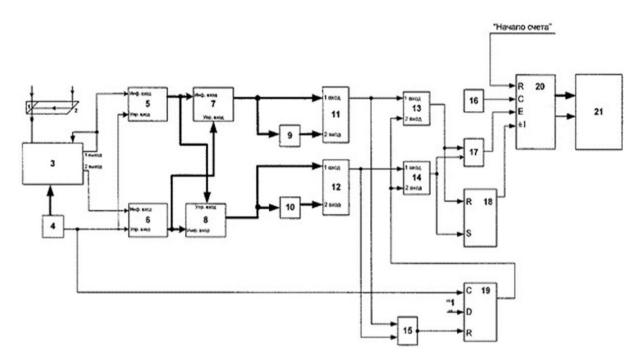


Рисунок Б.1 — Конструкция устройства для автоматизированного измерения малых угловых перемещений

Подп. и дата				
Инв. № дубл.				
Взам. Инв. №				
Подп. и дата				
.идог				

Подп.

Дата

Лист

№ докум.

ФСУиР.215.R3438.001 ПЗ

Лист

Приложение В

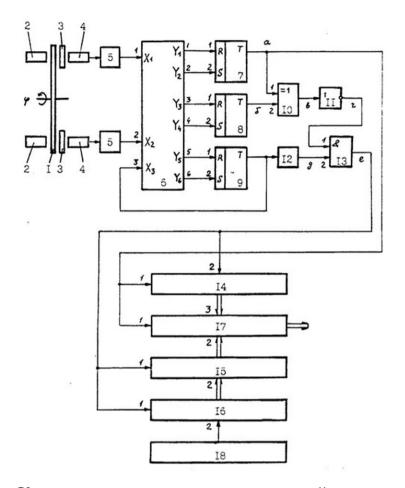


Рисунок В.1 – Конструкция датчика угловых и линейных перемещений: измерительный растр — 1; осветители — 2; индикаторные растры — 3; фотоприемники — 4; формирователи — 5; дешифратор — 6; Р-триггеры — 7, 8, 9; ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ — 10; инвертор — 11; ждущий мультивибратор — 12; схема И — 13; реверсивный счетчик координат — 14; генератор счетных импульсов — 18; счетчик — 16; регистр хранения длительностей интервалов времени — 15; блок определения координаты, скорости и ускорения — 17

Инв. № подл. и дата Взам. Инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ФСУиР.215.R3438.001 ПЗ

Приложение Г

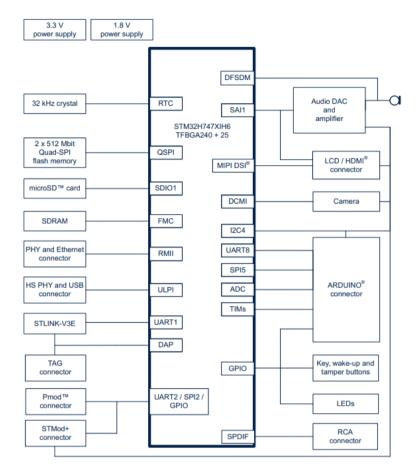


Рисунок Г.1 – Блок-схема аппаратной части МК STM32H747

Таблица $\Gamma.1$ — Параметры процессора

Тип процессора	32-битный Arm
	Cortex-M7
Скорость процессора (МГц)	до 480
Размер flash памяти (МБ)	2
Размер RAM (МБ)	1
Температурный диапазон работы (C°)	-40 +85
Мин. рабочее напряжение (В)	1.62
Макс. рабочее напряжение (В)	3.6
Количество АЦП	3
Разрядность АЦП	16 бит

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв. Nº дубл.

Инв.

Взам.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Приложение Д

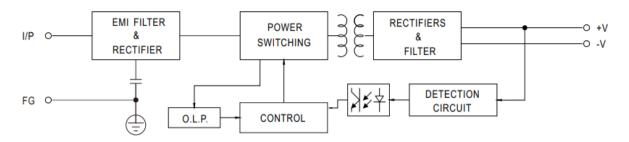


Рисунок Д.1 – Блок питания Mean Well EPS-15-5

Таблица Д.1 – Параметры блока питания

Характеристика	Значение
Напряжение питания (В)	220
Частота питающего напряжения (Гц)	50
КПД (%)	78
Выходное напряжение (В)	5
• , , ,	
Выходной ток (А)	2
Выходная мощность (Вт)	9.9

Инв. Nº подл. и дата Взам. Инв. Nº Инв. Nº дубл. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ФСУиР.215.R3438.001 ПЗ

Лист

Приложение Е

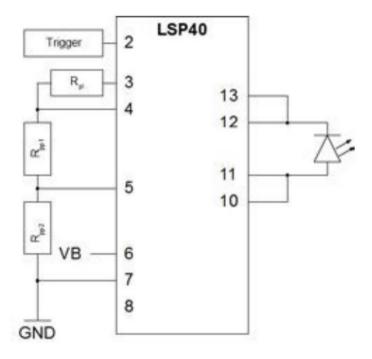


Рисунок Е.1 – Драйвер импульсного лазерного диода LSP-40

Таблица Е.1 – Параметры драйвера диода

Характеристика	Значение
Напряжение питания (В)	до 12
Ток драйвера (А)	0-40
Длина импульса (нс)	30-1000
Макс повт частота (кГц)	10
Габариты (мм)	40 x 40 x 10
Рабочий диапазон температуры (°С)	-10 +85

Подп. и дата	
лнв. N <u>º</u> дубл.	
Взам. Инв. Nº	
Подп. и дата	
.инв. N <u>е</u> подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Приложение Ж

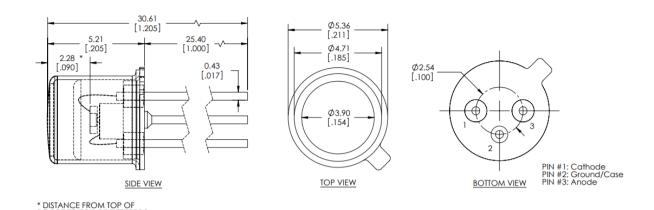


Рисунок Ж.1 – Фотодиод SAR500 F3 TO-46

Таблица Ж.1 – Параметры фотодиода

Характеристика	Значение
Диапазон длины волны (нм)	400-1100
Диапазон рабочих температур (°С)	-40 +85
Прямой ток (мА)	50
Обратный ток (мА)	5
Рассеивание мощности (мВт)	60
Время переходного процесса (пс)	450
Ток пробоя (А)	150

Подп. и дата	
инв. N <u>º</u> дубл.	
Взам. Инв. Nº	
Подп. и дата	
1нв. N <u>º</u> подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Приложение 3

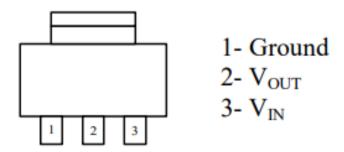


Рисунок 3.1 – Линейный регулятор напряжения AMS1117-3.3

Таблица 3.1 – Параметры линейного регулятора

Характеристика	Значение
Выходное напряжение (В)	3.3
Полярность	пол
Максимальный ток нагрузки (А)	0.8
Падение напряжения (В)	1.1
Максимальное входное напряжение (В)	15
Рабочая температура (°С)	-40+120
Вес (г)	0.39

Инв. Nº подл. и дата Взам. Инв. Nº Инв. Nº дубл. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Приложение И

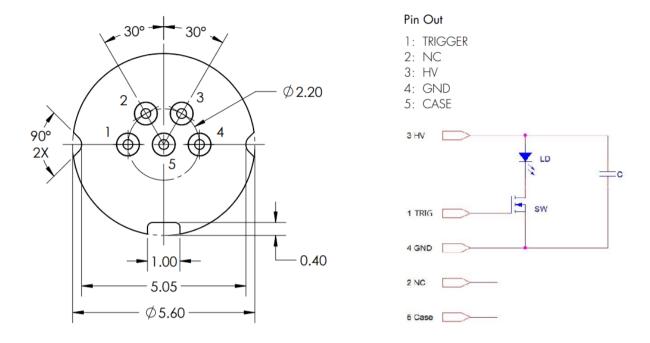


Рисунок И.1 – Импульсный лазерный диод QS-905D1S3JT0XU

Таблица И.1 – Параметры диода

Характеристика	Значение
Напряжение питания (В)	20-80
Рабочая температура (°C)	-40+85
Ток диода (мА)	1
Ширина импульса (нс)	2.5
Время переходного процесса (нс)	1.4
Номинальная частота повт (кГц)	10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Приложение К

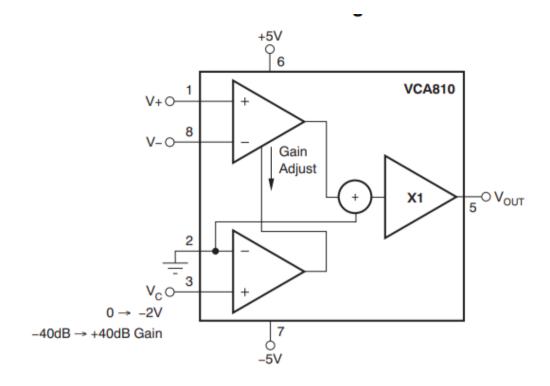


Рисунок К.1 – Усилитель напряжения VCA810

Таблица К.1 – Параметры усилителя напряжения

Характеристика	Значение
Диапазон усиления (дБ)	-40+40
Рабочая температура (°C)	-40+85
Напряжение питания (В)	45.5
Напряжение U_c (В)	-20
Время переходного процесса (нс)	12

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв. Nº дубл.

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Приложение Л

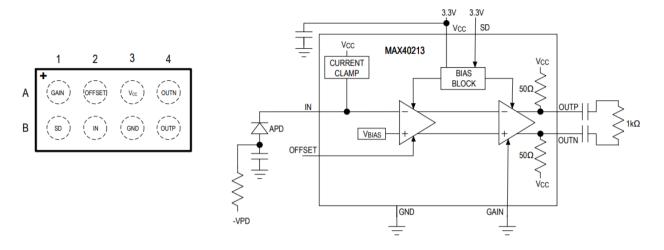


Рисунок Л.1 – Трансимпедансный усилитель МАХ40213

Таблица Л.1 – Параметры трансимпедансного усилителя

Характеристика	Значение
Напряжение питания (В)	-0.3+3.6
Рабочая температура (°C)	-40+125
Ток на выходах OUTP, OUTN (мА)	-20+20
Напряжение на OFFSET (B)	-0.3+0.3

Подп. и дата

Инв. № дубл.

зам. Инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Приложение М

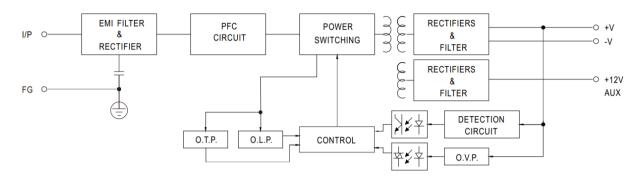


Рисунок М.1 – Блок питания Mean Well EPP-150-48

Таблица М.1 – Параметры блока питания

Характеристика	Значение
Напряжение питания (В)	220
Частота питающего напряжения (Гц)	50
КПД (%)	92
Выходное напряжение (В)	48
Выходной ток (А)	2
Выходная мощность (Вт)	100

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ФСУиР.215.R3438.001 ПЗ

Лист

Приложение Н

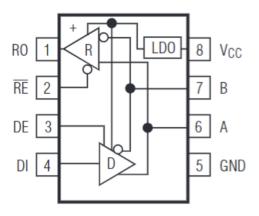


Рисунок Н.1 – Передатчик RS-485 MAX13410E

Таблица H.1 – Параметры передатчика RS-485

Характеристика	Значение
Напряжение питания (В)	310
Входная сила тока (мА)	10
Выходное напряжение (В)	3
Выходной ток (мА)	20

Подп. и дата	
Инв. Nº дубл.	
Взам. Инв. Nº	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Перв. примен.		Поз. обозначе- ние	Наименование		Примечание	
			<u>Конденсаторы</u>			
		C1, C2, C7, C8	КМ-5A-H90-10нФ±10%	2	ГОСТ 28898-91	
		C3, C4	2220-50B-X5R-0.1mκΦ±10%		Murata	
		C5, C6	0805-16B-X5R-10mκΦ±10%		Murata	
H			Микросхемы			
		DA1	EPS-15-5		Meanwell	
		DA9	EPP-150-48 1		Meanwell	
Š		DA2	AMS1117-3.3	AMS1117-3.3 1 Advanced Monolithic		
Справ. №		DA3	LSP-40 1 Laser Co		Laser Components	
J		DA4	QS-905D1S3JT0XU		Laser Components	
		DA5	VCA810		Texas Instruments	
		DA6	SAR500 F3 TO-46		Laser Components	
	DA7		MAX4013		Maxim Integrated	
_	DA8		MAX13410E		Maxim Integrated	
		DD1	STM32H747		ST Microelectronics	
1 дата						
Подп. и ,			<u>Резисторы по ГОСТ 29071-91</u>			
		R1, R6, R8, R10	PR0805-0.125-10кОм±0.5%			
.5		R5, R7, R12, R13	PR0805-0.125-20кОм±0.5%			
Инв. Nº дубл.		R3, R4, R9, R11	PR0805-0.125-1кОм±0.5%			
ЛНВ. Г		R2	PR0805-0.125-0.1кОм±0.5%			
H						
4HB. Λ			<u>Разъемы</u>			
Взам. инв. №		X1	PW-10-2-M		Herase	
B		X2	MAX485		Maxim Integrated	
та		7	- Nin De l'OS			
Подп. и дата						
Подг		Изм. Лист № докум.	ФСУиР.215.R3438 ПЭЗ			
5		Разраб. Кирбаба Д	.Д. Устройство для измере			
Δοπ <u>o</u> l		Пров. Быстров В	С. Устройство для измерения малых угловых перемещений Перечень элементов		1 Университет ИТМО	
Инв. Nº подл		Н. контр.			Факультет CУuP	
		Утв.			Группа R3438	

